

■ 公募情報

公募No.	2025T-106
職種	有期研究技術員
部署	ネットワーク研究所 先端 I C T デバイスラボ
業務名	先端ICTデバイスラボの設備・装置類の運営サポート業務（本部）
業務内容	先端 I C T デバイスラボ（以下、ラボという）は、埃の非常に少ない状態に維持されたクリーンルーム（プロセス室）を備え、各種の加工プロセスや評価測定のための設備・装置群が配備されています。半導体や誘電体材料を用いたデバイス等の試作により、先端的デバイス研究の推進に寄与しています。なお、ラボ内には、特に危険をとまなう装置関連業務（高圧ガス等を用いるドライエッチング装置、高温電気炉装置、高電圧装置や各種試薬を用いる実験装置等）が設置されています。業務内容は、上記装置等を利用したデバイス作製プロセス条件出し、マニュアル等の整備、研究用デバイスの試作支援、運営管理のための機構内における諸手続きや管理業務等を実施、及びラボ長・副ラボ長補佐としてラボ管理スタッフとの調整を行い、ラボの運営管理の実施を円滑に進める業務をして頂くものです。
自発的な研究活動等の実施に関して	機構内外の競争性を有する研究資金（科研費等）への申請資格があります。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無	【有】
応募要件	半導体等のデバイス加工プロセス、真空装置や光・電波計測装置等のデバイス研究開発に関心を持ち、電気・制御システム等に関する経験を有することが望ましい。また、先端ICTデバイスラボ内には、特に危険を伴う装置を取り扱うため、化学物質や高圧ガスの取扱に関する知識や制御システムに関する知識があることが望ましい。
募集人員	1 人
本年度契約期間	採用日 ～ 令和8年3月31日（更新の可能性：有り）
更新した場合の雇用期間（又は期日）	一定の条件を満たした場合に、採用日より最長5年
給与（基本給）	459,000円 ～ 515,000円／月 本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。
勤務地名称	本部 （東京都小金井市）
勤務頻度	週5日（週37時間30分勤務） ※時間外労働有

※ 部署名および勤務地名称（業務名、業務内容の記載を含む）に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。

※ 従事する業務及び勤務地の変更範囲：原則として変更無し

NICT有期雇用職員公募情報：<https://www.nict.go.jp/employment/koubo.html>